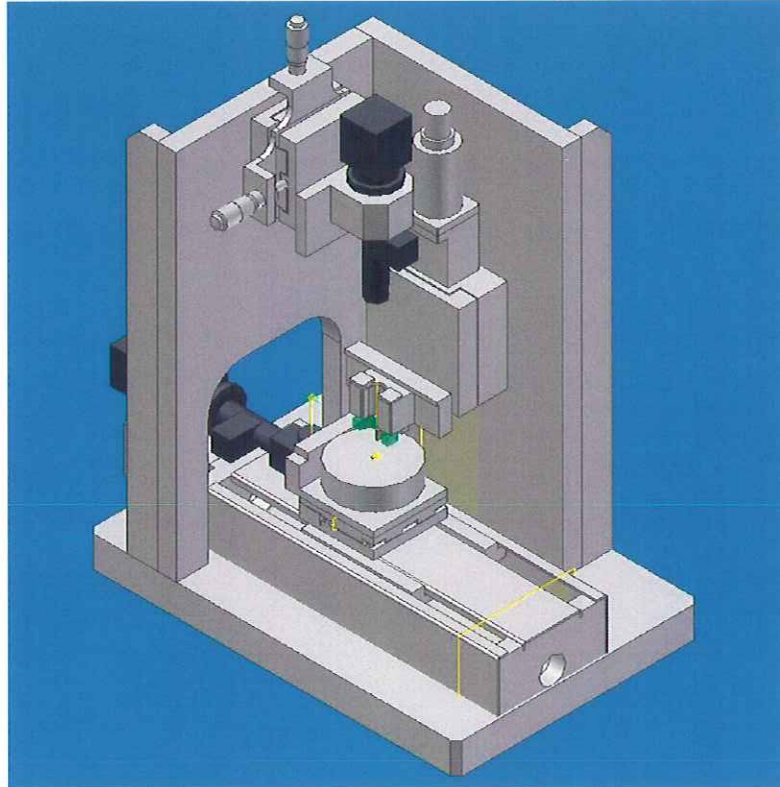


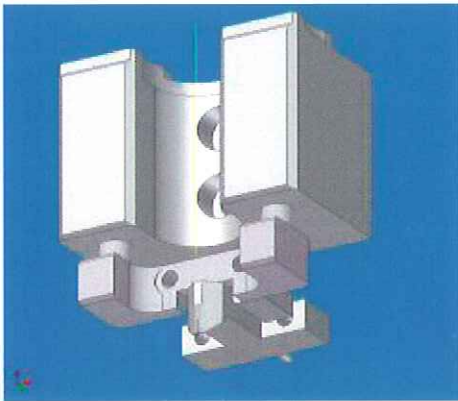
お手軽 100nm!

Nano WorkCell Type 10

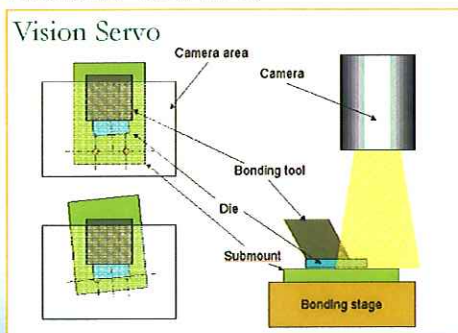
NanoWorkCellは、マイクロファクトリーを実現する設置面積A4サイズ、重量約30kgの超小型・低コスト・高精度な超精密部品アッセンブリ装置です。±100nmの高精度を驚異の低価格で御提供します。



●高精度フォース・コントロール・ユニット



●VISION SERVO



●特長

高精度: ±100nm

- ・高精度モータと高分解能エンコーダの採用により高信頼性高精度化を実現
- ・高い繰返し精度を実現する、高精度画像認識位置合わせ方式

幅広い対応

- ・新型微小光通信部品の試作開発～生産に対応
- ・SIP等組立精度100nmを必要とするMEMS半導体部品の試作開発～生産に対応
- ・Au-Sn共晶半田、UV接着剤など

優れた低加圧制御: ~ 5.00 (N)

- ・専用設計の低磨耗エアアクチュエータの採用
- ・~ 50 (N)用もラインナップ

コンパクト設計

- ・300mm (W) × 210mm (D) × 450mm (H) (Base Model size)
- ・インラインにも対応可能

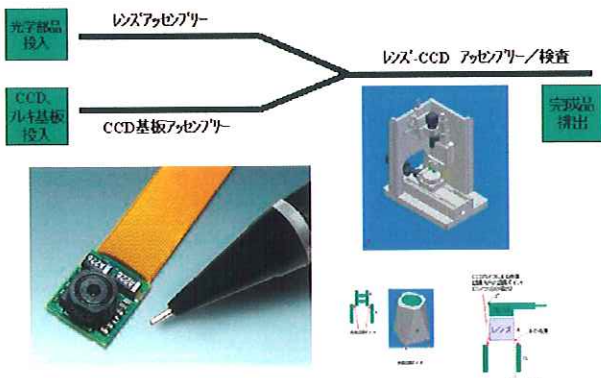
低価格

●主な仕様

		仕様
1.アライメント精度	X,Y θ	100nm $\pm 0.01^\circ$
2.荷重制御		~10(N)
3.サイクルタイム		5sec プロセス時間含まず
4.対象部品	①チップ ②基板	$\square 0.1\text{mm}$ to $\square 10\text{mm}$ ~ $\square 10\text{mm}$
5.装置寸法		300(W) × 210(D) × 450(H) mm
6.重量		約30kg
7.軸構成	①ヘッド Z軸ストローク/分解能	25mm/100nm
	②ステージ X軸ストローク/分解能	150mm/50nm(オプション:25nm)
	Y軸ストローク/分解能	50mm/50nm(オプション:25nm)
	θ Z軸ストローク/分解能	$270^\circ/0.0035^\circ$
8.ユーティリティー	①電源	AC100V $\pm 10\%$ 50Hz/60Hz
	②圧縮空気	Dry air 0.49(MPa)
	③真空源	-80kPa

※本仕様は改良の為予告なしに変更することがあります。

●ラインシステム事例



●レイアウト

